

下記の装置の利用については、Web による利用申請及び予約システムが対応しておりません。
 利用希望の際は、管理者へ直接お問い合わせが必要です。

機器名	問い合わせ先（機器利用）			
	管理担当者	設置場所	Email	内線
多チャンネル脳波/誘発電位 記録解析システム	寺本顕武（機械システム） 林喜章（機械システム）	本庄	hayashi[@]cc.saga-u.ac.jp	8516
スパッタリング装置	田中 徹（電気電子）		ttanaka[@]cc.saga-u.ac.jp	8872
プリント基板加工機	西山英輔（電気電子）		eisuke[@]cc.saga-u.ac.jp	8660
雰囲気制御 走査型プローブ顕微鏡	馬渡俊文（機械システム）		mawatari[@]cc.saga-u.ac.jp	8620
雰囲気制御チャンバー				
3D 測定レーザー顕微鏡				
真円度測定機 （タリロンド）				
高精度浸漬型 ワイヤ放電加工機				
CNC 表面性状測定機 エクストリーム				
微小硬さ試験機				
マイクロプレートリーダー	長田聡史（化学）		osadas[@]cc.saga-u.ac.jp	8551
デジタル・オシロスコープ	豊田一彦（電気電子）		toyoda[@]cc.saga-u.ac.jp	8510
精密万能試験機	森田繁樹（機械システム）		moritasi[@]cc.saga-u.ac.jp	8607
ファインカット （高速精密切断機）				
波長分散型蛍光 X 線 分析装置	角縁 進（教育学部）		kakubuch[@]cc.saga-u.ac.jp	8229